

MPI TS200-HP | 200 mmマニュアル型プローブシステム

10kV、600Aまでのハイパワー測定を正確、高信頼に

ライトカーテン

- インターロック制御されたライトカーテンによりオペレータが誤ってプローブシステムに侵入した場合にシステムを安全に停止
- Keysight B1505A および Keithley 測定器用インターフェース

アーク放電防止技術

- ArcShield™ 技術によりチャックとプローブ・プラテン間のアーク放電を防止
- 高電圧測定でウエハをアーク放電防止液に浸すためのトレイ、LiquidTray™

ポジションナ

- 最大 4 個の高電流および8個の高電圧マイクロポジションナ
- さまざまなポジションナより選定可能
- 同軸/トライアキシャル、高電圧/大電流専用プローブアームを用意

プローブ・プラテン

- プラテン高さを最大20 mmまで1 mmの高分能で調整
- DC/CV、RF および ハイパワー測定にも使用可
- RF マイクロポジションナ用角型調整器付き
- プローブ・プラテンのエア冷却により高い温度安定

ユニークなプラテンリフト機構

- 3つの決められたコンタクト位置：コンタクト、セパレーション (300 μm)、ローディング (3 mm)
- ローディングの位置で安全ロック
- 1 μm 再現性の“Auto Contact”位置
- 50、100 または 150 μm でのアライメント高さ

ShieldEnvironment™

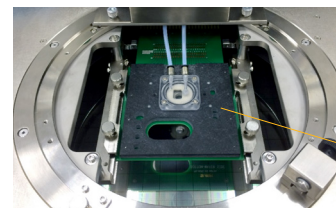
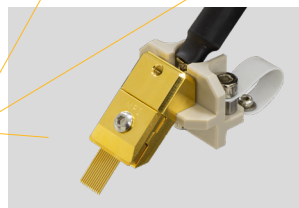
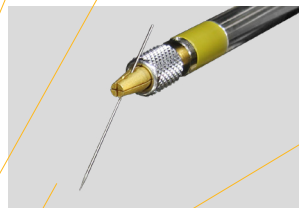
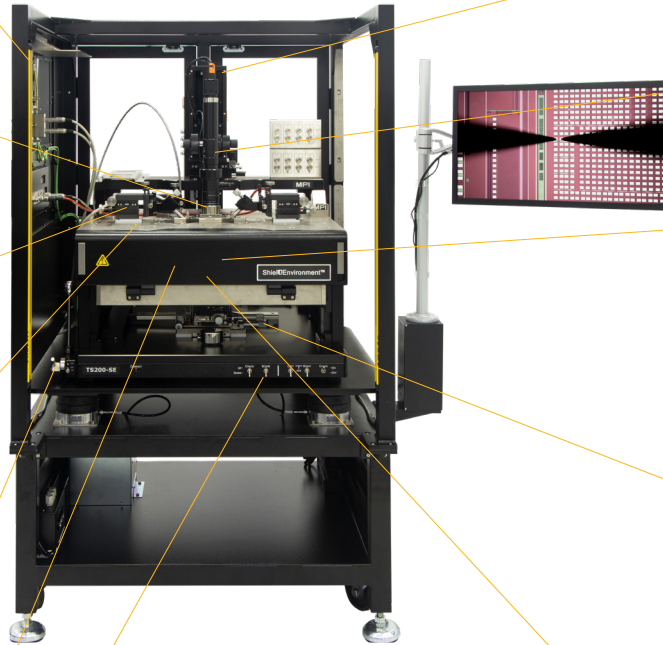
- 低雑音、低容量測定のための先進的EMIシールド および遮光機構
- 広い前面ドアよりIC/ウエハの出し入れが簡単に
- アイスフリー試験に有効な自動フロントドア・ロック

前面バキューム・コントロール

- 使いやすい、表示が明確
- 防振テーブルの組込

ハイパワープローブ

- 高電圧、低リーク、10 kVまで
- 高電流、マルチフィンガ型プローブ、200 A (パルス)まで
- 超高電力、マルチフィンガ型プローブ、10 kV/600 A (パルス)まで



顕微鏡マウント/移動機構

- 高精度顕微鏡のための安定マウント
- 50 x 50 mm リニア XY 移動機構
- 再構成を簡単にする、リニア Zリフト機構

顕微鏡および光学系

- 単眼鏡筒型 MPI SZ12, MZ12
- 最高12倍ズーム、101 mmの作動距離
- HDMI カメラモニターインターフェース、PC不要

モジュラーチャック

- 種々のハイパワー非温度チャック、温度チャックを用意
- 広い温度範囲、-60 °C ~ 300 °C
- 予算節約のためのフィールド・アップグレード・キット
- 薄型ウエハの取扱可能
- 10 kV (同軸)、3kV (トライアキシャル)
- 低接触抵抗の金のメッキ
- 計測器との安全接続可能な10kV チャック・コネクタ
- チャンバ・バーにチャック冷却空気の再利用

チャックXYZ ステージ移動

- チャックを片手で操作できるバックコントロール型エアベアリング・ステージ
- 全体移動範囲、225 x 260 mm (X-Y)
- マイクロメータでの微細調整範囲：25 x 25 mm (X-Y)
分解能 < 1.0 μm (0.04 ミル) @ 500 μm/rev
- チャック回転：360°、+/-5° 微細移動
- コンタクト時のXYステージの安全ロック機構
- 空気圧による20 mm のZ ロード・ストローク
- 5 mm の微細調整 Z、分解能 < 1.0 μm @ 500 μm/rev
- ウエハ・ローディングが容易な様にYレンジを拡張
- XおよびY軸の独立ロック機構 (オプション)

Safety Test Management™ (STM) System

- さまざまな温度下において測定環境が守られ、安全で、より信頼性の高い測定が可能に
- 露点コントロール機能により低温での測定を安定に実施
- 自動でCDAあるいは窒素の流量を監視
- 流量不足や流れが止まるなどの問題が起こった場合、自動的にチャックをセーフモードに切り替え

アーク放電防止プローブカード

- 10 kV/600Aまでの測定が可能な高気圧状態を用意
- +150 °Cまでの温度特性測定が可能